

産総研未公開特許出願情報

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
E-mail: aist-tlo-mi(@aist.go.jp を付けてください)

2017年10月分(18件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2017-192566	2017/10/2	材料評価装置	笠嶋 悠司
2	特願2017-193334	2017/10/3	汚れの影響を受けにくいひずみ分布測定方法とそのプログラム	王 慶華
3	特願2017-194812	2017/10/5	測定必要個数決定装置、測定必要個数決定プログラム及び測定必要個数決定方法、並びに、測定精度推定装置、測定精度推定プログラム及び測定精度推定方法	上田 高生
4	特願2017-195997	2017/10/6	誘電体材料評価装置	坂巻 亮
5	特願2017-196079	2017/10/6	可視光活性修飾炭素粒子・チタニアコアシェル複合体、その製造方法	王 正明
6	特願2017-197385	2017/10/11	記録装置、記録方法、プログラム、皮膚刺激装置および皮膚刺激方法	大山 潤爾
7	特願2017-197386	2017/10/11	身体動きガイドシステム、刺激呈示装置、刺激呈示方法およびプログラム	大山 潤爾
8	特願2017-197923	2017/10/11	電子源及び電子線照射装置並びに電子源の製造方法	村上 勝久
9	特願2017-197980	2017/10/11	water-in-oilエマルション培養における蛍光を用いた細胞増殖検出方法	大田 悠里
10	特願2017-200227	2017/10/16	メタンを炭素と水素に分解し、水素を製造するシステム	張 戦国
11	特願2017-202013	2017/10/18	反応生成物製造装置及びその方法	西岡 将輝
12	特願2017-202609	2017/10/19	圧力センサ、加速度センサ	柳 永勳
13	特願2017-202666	2017/10/19	光学歪み校正装置と光学歪み校正方法及び光学歪み校正プログラム	高瀬 竜一
14	特願2017-202691	2017/10/19	ロータリースクリーン印刷装置及びスクリーン製版の製造方法	野村 健一
15	特願2017-202748	2017/10/19	調湿装置及び調湿ケース	向田 雅一
16	特願2017-206005	2017/10/25	光応答性化合物及び該化合物を有効成分とする光応答性分散剤	神徳 啓邦
17	特願2017-209596	2017/10/30	電気伝導率測定用材料、電気伝導率測定膜、電気伝導率測定装置および電気伝導率測定方法、並びに電気抵抗率測定用材料、電気抵抗率測定膜、電気抵抗率測定装置および電気抵抗率測定方法。	寺崎 正
18	特願2017-209761	2017/10/30	圧力センサ	竹井 裕介